Vol. 26, No. 1 February, 2002

文章编号: 100+3806(2002)0+006602

# QBG 光束的传输特性\*

王喜庆

吕百达\*\*

(西南交通大学应用物理系,成都,610031) (四川大学激光物理与激光化学研究所,成都,610064)

摘要: 对变量为径项平方的贝塞耳函数调制的高斯光束(QBG 光束)通过一阶 ABCD 光学系统的传输变换进行了研究,由广义菲涅耳衍射积分出发推导出了普适的传输变换公式,以 QBG 光束通过薄透镜系统的情况进行了分析与讨论,对详细的数值计算结果进行了分析与讨论。

关键词: QBG 光束; ABCD 光学系统; 传输特性

中图分类号: 0435 文献标识码: A

## Propagation properties of OBG beams

Wang Xiqing

(Department of Applied Physics, Southwest Jiaotong University, Chengdu, 610031)

L Baida

(Institute of Laser Physics and Laser Chemistry, Sichuan University, Chengdu, 610064)

**Abstract:** The propagation of the Bessel-modulated Gaussian beams with quadratic radial dependence (QBG beams) has been studied, where the passage of QBG beams through a first-order paraxial *ABCD* optical system has been expressed in a closed-form. As an example, the propagation through a thin lens has been discussed. Numerical calculation examples have been presented to illustrate the propagation properties of QBG beams.

Key words: QBG beams; ABCD optical system; propagation property

## 引 言

最近,由 Caron 和 Potvliege 提出了一类新的贝塞 耳高斯光束,即径项变量为 r<sup>2</sup> 的贝塞耳函数调制 的高斯光束(以下简称为QBG 光束),它是近轴近似 下波动方程的解<sup>[1]</sup>。QBG 光束的许多特性还有待 于进一步的研究,如当其参数取某些值时,具有的非 高斯特性、轴上分布的平顶特性等。笔者对QBG 光 束通过一阶 ABCD 光学系统的传输特性进行了研 究,给出了普适的传输公式;对QBG 光束通过薄透 镜且入射面不在薄透镜所在平面的情况给出了一般 的传输公式,对数值计算结果进行了分析与讨论。

1 理论推导

 1.1 QBG 光束通过一阶 *ABCD* 系统的传输特性 QBG 光束在 *z* 平面上的场分布为<sup>[1]</sup>:

\* 西南交通大学科学研究基金资助项目。

\* \* 西南交通大学客座教授。

作者简介:王喜庆,男,1959 年 7 月出生。副教授。从 事光束传输与变换等研究。

收稿日期: 2000-08-07; 收到修改稿日期: 2000-11-03

$$E(r, \varphi, z) = A_0 \frac{w_0}{w(z)} e^{ikz} J_{|m|/2} \left( \frac{\mu^2}{w^2(z)} \right) \times \exp\left[ -\frac{1+i(\mu^2+1)z/z_R}{w^2(z)} r^2 \right] e^{im\varphi}$$
(1)

式中,

 $w(z) = w_0 \sqrt{1 - (\mu^2 + 1)(z/z_R)^2 + i2z/z_R}$  (2) J<sub>1 m1/2</sub>表示| m | / 2 的贝塞耳函数, k 代表波数,  $\mu$  是 与 QBG 光束相关的参数, z<sub>R</sub> 表示基模高斯光束的瑞 利长度, w<sub>0</sub> 表示在 z = 0 时 w(z) 的值, 即基模高斯 光束的束腰半径。

当QBG 光束通过无光阑的一阶 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 光学系统时其场分布由柱坐标下的广义菲涅耳衍射积分给出<sup>[2]</sup>:

$$E(r, \varphi, z) = -\frac{i}{\mathcal{B}} \exp(ikL) \iint E_0(r_0, \varphi_0, z_0) \times \exp\left\{\frac{ik}{2B} [Ar_0^2 + Dr^2 - 2rr_0\cos(\varphi_0 - \varphi)]\right\} \times rodrod\varphi_0$$
(3)

式中,  $\lambda$ 为光束波长, A, B, C, D 是一阶光学系统的 矩阵元素, 且 AD- BC= 1, 假设光束的 z= 0 平面位 于入射面,则(1)式可得:

$$E(r_0, \varphi_0, z_0|_{z_0=0}) = A_0 J_{|m|/2} (\mu r_0^2 / w_0^2) \times$$

$$\exp(-r_0^{-7} w_0^{-7}) \exp(1m\Psi_0)$$
 (4)  
将(4) 式代入(3) 式并利用贝塞耳的积分表达式<sup>[3]</sup>:

$$J_n(x) = \frac{i^n}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp(-ix\cos\theta + in\theta) d\theta \qquad (5)$$

及积分<sup>[4]</sup>:

得到:

$$\int_{0}^{\infty} \exp(-pt) J_{v}(t) J_{2v}(2\sqrt{at}) dt = \frac{1/2}{(p^{2}+1)^{1/2}} \exp\left(-\frac{ap}{p^{2}+1}\right) J_{v}\left(\frac{a}{p^{2}+1}\right)$$
(6)

 $E(r', \Psi, z) = (-i)^{m+1} \frac{\pi_{W0}^{2} / M}{\sqrt{\mu^{2} + [1 - (ikAw_{0}^{2} / 2B) / 2B)]^{2}} \times J_{1 m l/2} \left[ \frac{(k^{2}w_{0}^{4} W'^{2} / 4B^{2})}{\mu^{2} + (1 - ikAw_{0}^{2} / 2B)^{2}} \right] \times \exp \left\{ - \left[ \frac{k^{2}w_{0}^{4}}{4B^{2}} \left( 1 - \frac{ikA}{2B} w_{0}^{2} \right)^{2} - \frac{ikD}{2B} w_{0}^{2} \right] r'^{2} \right\} \times \exp \left( im\Psi \right) \exp (ikz)$  (7)

式中,为书写方便略去了常数 Ao, r' = r/wo 为归一 化坐标。

当 *B*= 0(对应于成像情况)时,由 Collins 公式<sup>[5]</sup> 及 δ函数得:

$$E(r, \varphi, z) = \frac{1}{A} e^{ikz} \exp\left(\frac{ikC}{2A}r^2\right) \times J_{|m|/2} \left(\frac{\mu^2}{A^2w^2}\right) \exp\left(-\frac{r^2}{A^2w^2}\right) e^{im\varphi}$$
(8)

(8) 式即是 B = 0 情况下, QBG 光束经过一阶 ABCD 光学系统后的场分布。

 (7)式和(8)式是在无光阑限制下光束通过一阶
A B C D
C D
光学系统通用的传输公式。

1.2 光束通过无光阑聚焦薄透镜的传输
当焦距为f 的薄透镜位于z=0平面时,如图1



Fig. 1 Illustration of the OBG beams through a thin lens system

所示, 表征光,学系统的变换矩阵为:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - z/f & s(1 - z/f) + z \\ - 1/f & - s/f \end{bmatrix}$$
(9)

令 
$$B=0,$$
得  $z=\frac{s}{s/f-1}$  (10)

则 
$$A = 1 + \frac{s/f}{1 - s/f}, C = -1/f$$
 (11)  
将(11) 式代入(8) 式,得:

$$E(r, \Psi, z) = \frac{1}{1 + \frac{s/f}{1 - s/f}} e^{ikz} \exp\left[\frac{-\frac{ik/f}{2}}{1 + \frac{s/f}{1 - s/f}}\right] \times J_{|m|/2} \left[\frac{\frac{1}{1 + \frac{s}{1 - s/f}}^2}{1 + \frac{s/f}{1 - s/f}^2}\right] \exp\left[\frac{-r^2}{1 + \frac{s/f}{1 - s/f}^2}\right] \exp\left[\frac{(12)^2}{1 + \frac{s/f}{1 - s/f}^2}\right]$$

将(11)式代入(7)式,得:

$$E(r', \Psi, \Delta z) = \frac{(-i)^{m+1}\pi N_f \exp(im\Psi)}{\sqrt{\mu^2 [1 + \Delta z (1 - s/f)]^2 + [1 + \Delta z (1 - s/f) + i\pi N_f \Delta z]^2}} \times J_{1ml/2} \left[ \frac{\pi^2 N_f^2 \mu'^2}{\mu^2 [1 + \Delta z (1 - s/f)]^2 + [1 + \Delta z (1 - s/f) + i\pi N_f \Delta z]^2} \right] \exp[ihf(1 + \Delta z) + s] \times \exp\left\{ - \left[ \frac{\pi^2 N_f^2 \left[ 1 + i\pi N_f \frac{\Delta z}{1 + \Delta z (1 - s/f)} \right]}{\mu^2 [1 + \Delta z (1 - s/f)^2 + [1 + \Delta z (1 - s/f) + i\pi N_f \Delta z]^2} - i\pi N_f \frac{1 - s/f}{1 + \Delta z (1 - s/f)} \right] r'^2 \right\}$$
(13)

式中,  $\Delta z = (z - f)/f$ ,  $N_f = w_0^2/K$ 为菲涅耳数。 (13)式即为入射面在薄透镜前经薄透镜传输后的场 分布函数。

为说明(12) 式及(13) 式的应用,以(13) 式为例, 我们计算了 QBG 光束当 *s* = 0, *Nf* = 0.08, *m* = 0 及 *m* = 1 时经无光阑薄透镜聚焦情况,QBG 光束横向光 强的分布,如图 2 所示。 图 2a~ 图 2d 为 s= 0 时不同参数的 QBG 光束 经无光阑薄透镜聚焦后横向光强分布。由图 a、图 c 可以看出,当 µ 取实数、纯虚数及复数时,其横向光 强分布是不相同的。当 µ 取复数且实部与虚部大 小相当时,µ对光强的影响是由实部与虚部共同起 作用;由图 b、图 d 可以看出,当 µ 的实部远大于虚 (下转第70页)

## 2.2 性能测试

对激光淬火后的试样进行拉伸试验(60:万能试验机)和冲击韧性(PSW3000/1500试验机)试验,用 传统淬火为A组、激光淬火为B组,每组3件,取平 均值。对试件进行对比,其数据见表2。

Table 2 Test components service time and attrition value

text	$\sigma_{\rm b}$	$\boldsymbol{\alpha}_{K}$	hardness	method
components	/MPa	/ J• cm <sup><math>-2</math></sup>	/ HRC	netroa
А	1700	70	56~ 60	fumace quenching
В	1900	80	60~ 62	laser beam hardening

2.3 试验结果分析与应用

采用激光淬火的零件可使用 288~ 300h, 总的成 品合格率为 98%, 变截面处的硬度一致, 零件 1 处 和 2 处几乎没有变形, 内应力小, 合格品高。传统的 淬火工艺处理后, 冲头尖角 1 和 2 处(见图 1) 易产生 应力集中、变形和裂纹, 其合格品率为 92%。同时 要考虑对机械加工工艺参数优化, 这样才可以有效 地防止微裂纹的产生。从表 1 实验可知, 经过激光 淬火的试件在线使用寿命高于传统工艺处理的零

(上接第67页)

部时, <sup>μ</sup>对光强分布的影响主要决定于实部, 虚部仅 对旁瓣有微小的影响。当 μ 的实部较大时, 如图 2b、图 2d, 横向光强分布有旁瓣出现, 这是由贝塞耳 函数本身决定的。



Fig. 2 The intensity distribution of QBG beams focused by an unapertured thin lens

2 总 结

本文由广义菲涅耳衍射积分出发推导出了 QBG光束通过一阶 ABCD 系统的一般传输公式及成 件。激光淬火后试件金相组织其组织细密均匀。有 效表面主要为细小针状马氏体。由表 2 可看出,激 光淬火试件的强度和抗冲击性能优于传统处理的试 件。

# 3 结 论

实验说明, 经激光淬火的圆片冲头零件在线使 用时间为 264~ 288h(每天按 8h, 两班工作制, 为 18 ~ 19d), 成品合格率高于传统淬火工艺。激光淬火 变截面处的硬度一致, 内应力小, 金相组织细密均 匀, 主要为细小针状马氏体, 在工作时冲头刃口不易 产生微裂纹和不正常的剥落。对淬火后零件加工工 艺参数进行优化, 有效地防止了变截面的零件在精 加工时产生微裂纹。采用激光淬火与淬火后精加工 工艺参数优化的综合研究, 使药物圆片冲头具有好 的耐磨擦磨损、抗冲击性能, 使用寿命明显提高。

### 参考文献

- [1] 胡昭如. 机械工程材料. 长沙: 中南工业大学出版社, 1991.
- [2] 林秀珍. 机械工程材料, 2000(4): 40~41.

像系统的变换公式。以 QBG 光束通过薄透镜系统 为例, 对于入射面位于薄透镜前 s 处, 出射面位于薄 透镜后 z 处的一般情况给出了传输变换公式, 并以  $N_f = 0.08, m = 0, m = 1, \Delta z = -0.2, \mu$  取不同值时, 做了数值计算, 计算结果表明当  $\mu$  的实部与虚部 (均指绝对值, 以下同) 大小相当时( $| \operatorname{Re}(\mu) | < 1$ ), 横向光强由实部与虚部共同决定, 而当实部远大于 其虚部时, 实部对横向光强分布起主要作用; 当实部 大于1时, 横向光强分布有旁瓣出现。由(8) 式分析 得到, 当 QBG 光束经过成像系统时, 其横向光强分 布与入射光强分布的形状相似, 其光强减小为入射 光强的  $A^2$  倍, 其横向光强分布在径向拓展为入射时 的  $A^2$  倍。本文的结果将对 QBG 光束的特性研究及 应用有一定的参考意义。

### 参考文献

- [1] Caron C F R, Potvliege R M. Opt Commun, 1999, 164: 83.
- [2] Collins S A. J O S A, 1970, 60: 1168.
- [3] 梁昆森. 数学物理方法. 3 版, 北京: 高等教育出版社, 1998.
- [4] Erdelyhi A Tables of Integral Transforms. New York: McGraw-Hill, 1954.
- [5] 吕百达. 强激光的传输与控制, 北京: 国防工业出版社. 1999.